20240910 夜間利用のルール追加

試料作製室の利用案内

場所：千現地区 精密計測実験棟 103 室

■利用可能時間と利用対象者

- 利用可能時間は平日 9:00～16:30 です（※）。
- ライセンス保持者のみ入室可能で、ライセンスを取得した装置のみ利用可能です。
- ライセンスは年度ごとに更新手続きが必要です。
- 入退室の際はスタッフルーム（精密計測実験棟 101 室）でカードキーを借用/返却ください（※）。

※：NIMS 職員の夜間利用者は平日 9:00～20:30 まで、手続きをすれば自身の ID カードで入室可能です。

■予約ルールと利用料金

- 要予約の装置と予約不要の装置があります。
- **要予約の装置**

  ・精密イオン研磨装置 Model 691 PIPS
  ・イオンスライサー Ion Slicer EM-9100IS
  ・ディンプルグラインダー Dimple Grinder
  ・自動精密切断機 ISOMET Low Speed Saw
  ・精密研磨装 Multiprep System

  - 操作講習は「技術補助」、ライセンス取得後は「機器利用」の利用料金がかかります。
  - ライセンス取得後は、予約システムにて、1 時間単位で予約ください。
    例：10:30-12:00 は NG /10:00-12:00 は OK
  - 予約システムの入力時間は、利用料金にそのまま反映されます。一日使用する場合は休憩時間の前後で予約を分けられます。
  - 1 日の予約枠の数に制限はありません。
  - 予約日の前日までは予約システムでキャンセルや変更が可能です。
  - 急な予約のキャンセルや変更をご希望の際は、電子顕微鏡ユニット事務局 (tem@nims.go.jp)および担当スタッフにご連絡ください。

- **予約不要の装置**
  - その他の装置（コーター類等）は、ライセンス保持者であれば、予約なしで利用可能です。ただし、他のユーザーと時間が被る可能性があることを予めご了承ください。
  - 操作講習は「技術補助」の利用料金がかかりますが、ライセンス取得後の「機器利用」は非課金です。

20240910 夜間利用のルール追加

TEM 試料作製装置群の装置リスト

要予約

■自動精密切断機 ISOMET Low Speed Saw

・低速回転/軽荷重

・4 インチダイヤモンド切断砥石

・ブレード回転数: 0～300 rpm

■精密イオン研磨装置 Model 691 PIPS

・加速電圧: 0.1～6 kV

・研磨角: ±10°(0.1°ステップ)

・使用ガス: アルゴン

・液体窒素冷却ステージ

■精密研磨装置 Multiprep System

・試料傾斜角度: 0～10°

・研磨盤回転速度: 5～350 rpm

・試料研磨荷重: 0～600 g

・精密マイクロメーター付き

■ディンプルグラインダー Dimple Grinder

・試料研磨ホイール径: 15 mm

・試料研磨荷重: 0～40 g

・研磨ホイール回転速度: 0～600 rpm

・初期試料厚さ: 200 μm 以下

・自動停止機構付き

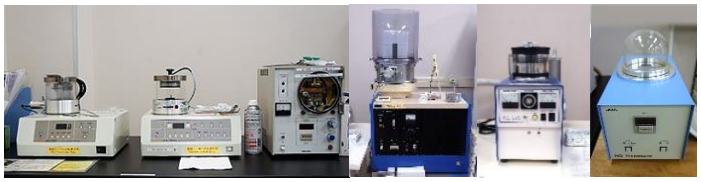
■イオンスライサー Ion Slicer EM-9100IS

・加速電圧: 1～8 kV

・研磨角: ±6°(0.1°ステップ)

・使用ガス: アルゴン

予約不要



・カーボンコーター JEC-560

・白金コーター JFC-1600

・金コーター JFC-1500

・オスミウムコーター HPC-1SW

・ターボ式真空蒸着機 SVC-700(蒸着源要持参)

・親水化処理装置 DII-29020HD

・その他(ホットプレート等)